

先進電子材料評価センター オープン記念内覧会

5G/6Gによる高速通信でIoTを繋ぐ近未来のデジタル社会を迎えるために必要な材料開発を支援する機器センターを令和4年1月にオープン。電子回路用基板材料や各種電子デバイス用材料、電磁波シールド材料などに求められる高周波誘電特性や半導体特性を評価する装置を設置しています。当日は、当機器センターの紹介に加え関連施設の見学会も実施致しますので、この機会に是非お越しください。

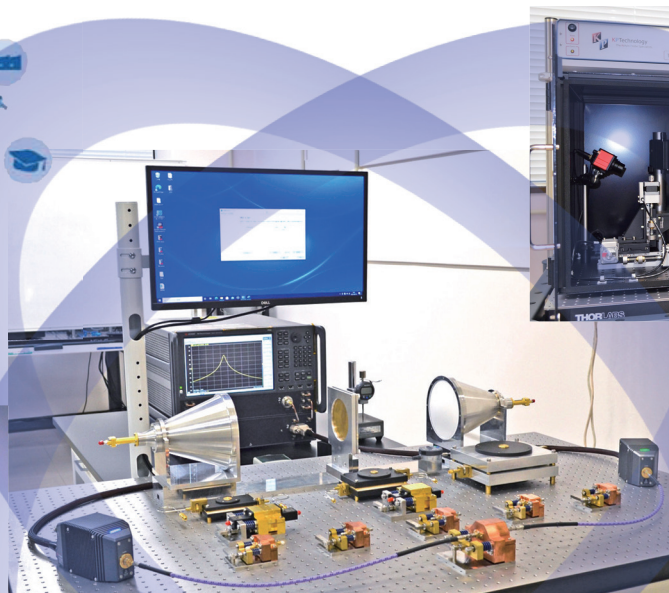
日程 令和3年12月17日(金) 14:00～16:00 受付開始 13:30

主催 地方独立行政法人大阪産業技術研究所

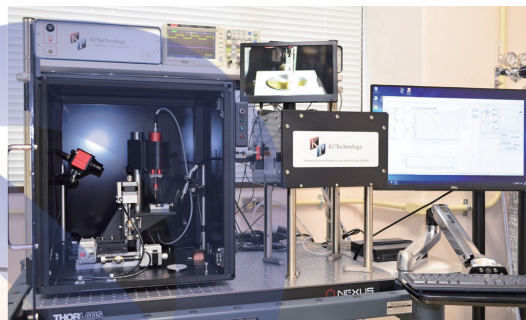
場所 地方独立行政法人大阪産業技術研究所 森之宮センター

定員 30名(定員になり次第締切)

参加費 無料



誘電特性評価システム



仕事関数測定システム



ホール効果測定装置



未来を拓く高速通信やIoT関連の材料開発を支援します!

● 内覧会のスケジュール

13:30 受付開始

14:00 開会

理事長挨拶 大阪産業技術研究所理事長 小林 哲彦

先進電子材料評価センター概要説明

施設見学についての説明

○施設見学

先進電子材料評価センター、電池開発評価センター、次世代光デバイス評価支援センター

閉会挨拶 大阪産業技術研究所森之宮センター長 小野 大助

16:00 閉会予定

● 設置装置一覧

装置名	概要
誘電特性評価システム	比誘電率、誘電正接、透磁率
ミリ波ネットワークアナライザ (Keysight Technology) N5290A	測定周波数範囲 900 Hz~110 GHz
スプリットポスト共振器 (Keysight Technology)	共振周波数 1.1、2.5、5 GHz
スプリットシリンダー共振器 (EMラボ)	共振周波数 10、20、28、40、60、80 GHz
導波管サンプルホルダ・フィクスチャ (EMラボ)	X、Pの2バンドで 8.2~18 GHzに対応
斜入射対応フリースペース (EMラボ)	K、R、U、E、Wの5バンドで 18~110 GHzに対応
仕事関数測定システム (KP Technology) APS02	光電子収量分光法 測定範囲3.4~7.0 eV ケルビンプローブ法 測定範囲に制限なし
半導体特性測定装置 (Fluxim) Paios	キャリア移動度 (Celiv法) $10^{-6} \sim 10^{-2} \text{cm}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}$ 、他
ホール効果測定装置 (東陽テクニカ) Resitest8310	キャリア移動度 $> 10^{-2} \text{cm}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}$ 、他
触針式微細表面形状測定装置 (Bruker) Dektak XT-A	高さ分解能 1 Å、2Dおよび3Dプロファイル対応
真空蒸着装置 (アルバック機工) VPC-260F	膜厚モニター付、共蒸着対応

● お申込先

大阪産業技術研究所ホームページにて

<https://orist.jp/morinomiya/events/seminar/2021/12/20211217.html>



申込先QRコード

お問合せ先

地方独立行政法人大阪産業技術研究所 企画部 内村、辻谷

TEL : 06-6963-8331 FAX : 06-6963-8015 E-mail : mail@omtri.or.jp URL : <https://orist.jp/>